

第7回商標五庁（TM5）年次会合に参加しました。

2018年11月5日

11月1日及び2日に、日米欧中韓による商標五庁（TM5）年次会合が、韓国・ソウルで開催されました。

会合では、日本国特許庁（JP0）が主導する「悪意の商標プロジェクト※1」、「イメージサーチプロジェクト※2」、「ユーザー参画プロジェクト※3」及び「品質管理プロジェクト※4」を含む計14の協力プロジェクトについて、進捗状況及び今後の進め方に関する活発な議論を行いました。

また、商標侵害対策に関する啓蒙活動を行う新たなプロジェクトが採択されました。

さらに、ユーザーセッションでは、業界団体・代理人団体等のユーザー代表者の皆様と、「イメージサーチにおけるAIの活用」、「第4次産業革命」等のテーマについて活発な意見交換を行いました。

なお、来年の第8回TM5年次会合は、日本特許庁（JP0）が主催することで合意されました。

※1 悪意の商標出願に関し各庁の制度・運用の情報交換を行うとともに、ユーザーに対してこれらの情報提供を行うことを目的としている。

※2 図形サーチシステムの開発及び実施における問題及び可能な解決策を定義し、現在及び将来、各庁が独自にイメージサーチを導入する際に参考となるような成果物の作成・共有を目的としている。

※3 TM5の各協力プロジェクトにユーザー団体を参画させること及び一般ユーザーへの情報発信のためのワークショップを開催することを目的としている。

※4 TM5各庁の商標審査の実施体制や審査の質の向上のための取組等に関する情報収集・共有を行うことを目的としている。



野口審査業務部長（左端）と各庁代表者